

金相顯微鏡

在金相學當中，金相顯微鏡廣泛應用於分析金屬的微觀結構和晶粒組織，或者尋找導致材料有缺陷位置以及特徵。

正立式



LV150N 系列

		Brightfield	Darkfield	DIC	Fluorescence	Polarizing	Phase-contrast	Two-beam interferometry
LV150/LV150NA	Episcopic	○	○	○	○	○	—	○
LV150NL		○	—	○	—	○	—	○

倒立式



MA200(專業型)

Brightfield	Darkfield	Simple Polarizing	DIC	Fluorescence
○	○	○	○	○



MA200(經濟型)

Brightfield	Darkfield	Simple Polarizing	DIC	Fluorescence
○	—	○	—	—

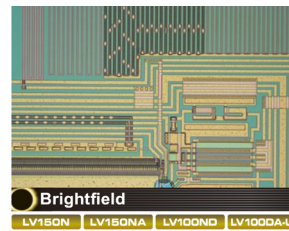
TU Plan Fluor Series

EPI / BD 5x / 10x / 20x / 50x / 100x

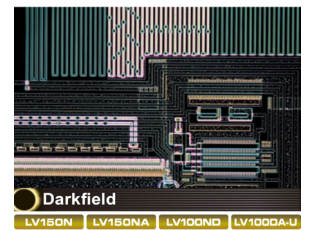


通用型標準物鏡

新的半复消色差透鏡結合卓越的色差表現與所有的放大倍率工作距離長，以適應任何應用程序。兼容明視野、暗視野、微分干涉、偏光、螢光等機能。



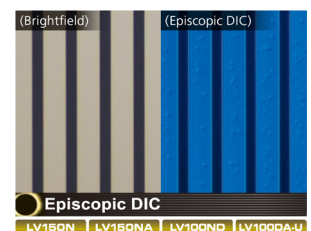
明視野



暗視野



偏光



微分干涉 DIC

DS-Fi3

專用高速攝像頭

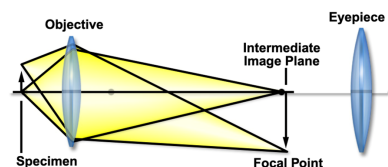
NIS-Elements D 金相軟體專用攝像頭，具備高解析、高幀率、低延遲特性。



5.9 megapixel Color High-resolution

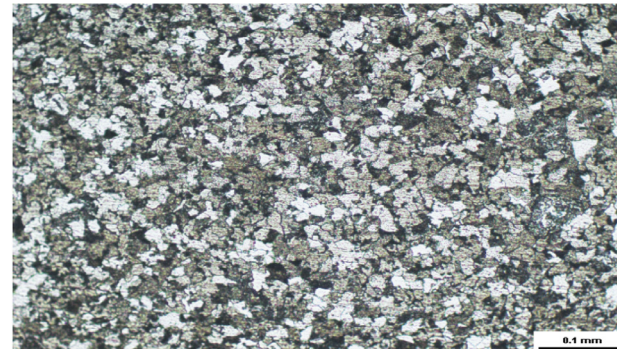
CFI60-2

尼康公司的 CFI60 光学系統，由其獨特的高 NA 值和長工作距離的概念而受到高度評價，進一步發展色差校正和輕量化方面，時至今日達到頂點巔峰。



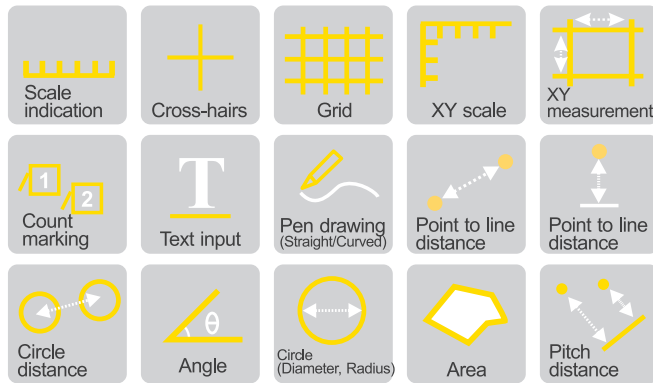
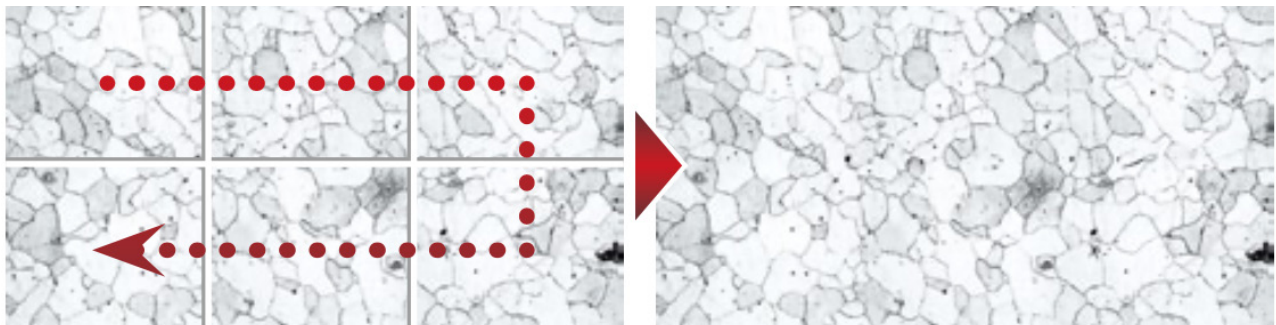
金相分析軟體

適用於各種金相觀察分析，如粒徑分析 (Grain Size)、金相組織辨識及含量分析、面積比或者計量等等，用戶可以在其應用程序需要不同的成像方式時輕鬆地在顯微鏡系統之間切換。可以選擇各種金相模組輕鬆組合和分析，以擴展您的研究方向。



大圖拼接功能

可以實現將多個視場縫合以創建一個圖像。



景深合成	金相模塊 (選購) 高倍率鏡頭下景深較淺，試片如有高低落差，可使用此功能進行景深合成。
晶粒度及自動計數	分析金相組織晶粒度 (JIS G0551、ASTM E112等規範)，自動定義組織百分面積比例。
鑄鐵球化率	鑄鐵的石墨球化 (JISG5502、ASTMA247-06)

金相前
處理設
備

金相
材料

洛氏
硬度計

勃氏
硬度計

維氏
硬度計

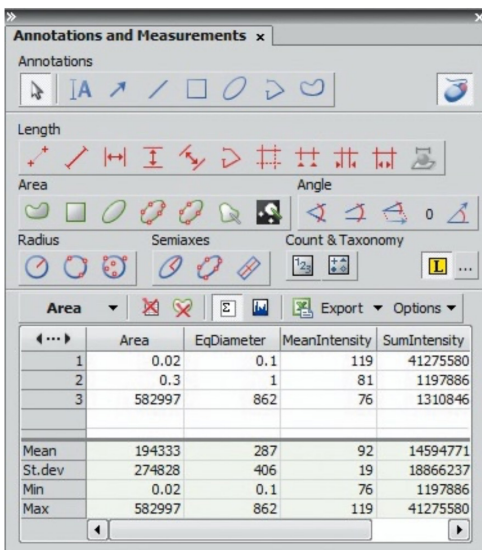
手提式
硬度計

無損
檢測

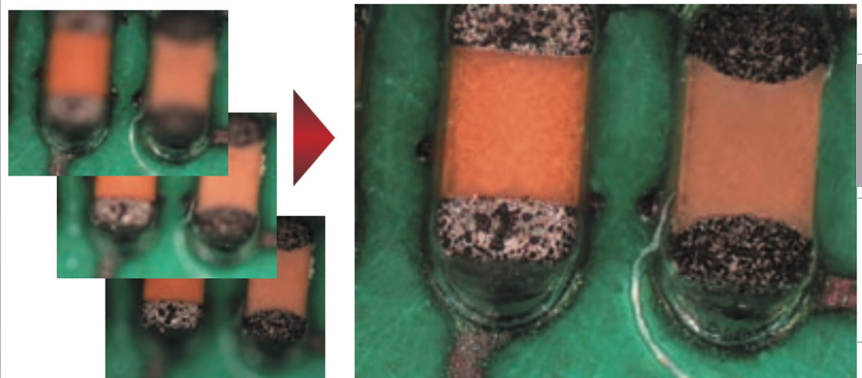
金相
顯微鏡

硬度配
件及
材料

參考
資料



形狀測量



EDF 景深合成